

بهبود رفتار ترشوندگی سل حاوی تنگستن برای لایه‌های نازک اکسید تنگستن

محمد علی بهرهور^{*}، یداله گنج خانلو، محمود کاظمزاد، هوشنگ عزیزی

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادیها، کرج، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۳/۲/۱۴، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۳/۱۲/۳، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۳

چکیده: در این کار لایه‌های اکسید تنگستن بر روی الکترود شفاف اکسیدی و همچنین شیشه نوری با استفاده از روش فروبری در سل‌های پایه آبی و الکلی آماده و سپس در ۴۰۰ درجه عملیات حرارتی گردیدند. ترشوندگی لایه‌های مورد استفاده توسط سل‌های آماده شده نیز با مشاهدات چشمی و تصویربرداری بررسی شد. لایه‌های آماده شده با میکروسکوپ الکترونی رویشی، پراش اشعه X و همچنین ولتاوری چرخه‌ای در محلول اسیدسولفوریک مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که زیرلایه‌های مورد استفاده توسط سل‌های آبی آماده شده، ترشوندگی نامطلوبی دارند در حالی که سل‌های پایه آبی - الکلی به خوبی دو زیر لایه مورد استفاده را تر می‌کنند. ترشوندگی زیر لایه حین خشک کردن در صورت استفاده از اتانول در سل‌های مخلوط آبی - الکلی کاهش می‌یابد این مشکل با استفاده از یک الکل سنگین (لوریک الکل) برفع گردید که این کار به عنوان روش بهینه تهیه سل برای لایه نشانی اکسید تنگستن با استفاده از اسید هیدروکسی تنگستیک تهیه شده از پیش‌ماده سدیم تنگستات تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد که حضور لوریک الکل اندازه دانه‌ها و بلورک‌ها را از حدود ۴۰ نانومتر تا زیر ۲۰ نانومتر کاهش می‌دهد و فاز لایه نیز از مونوکلینیک به تریکلینیک تبدیل می‌شود. داده‌های ولتاوری چرخشی نیز خواص بهبود یافته الکتروکرمیک لایه اکسید تنگستن آماده شده را تایید می‌کند.

کلمات کلیدی: اکسید تنگستن، الکتروکرومیزم، سل - ژل، ترشوندگی، لایه نازک.

On the substrate wettability of a tungsten sol for the preparation of WO_3 thin films

Mohammad Ali Bahrevar*, Yadolah Ganjkhani, Mahmood Kazemzad, Houshang Azizi

Materials and Energy Research Center, Semiconductor dept, Karaj, Iran

Abstract: In this work, WO_3 thin films have been deposited on optical glass and transparent conducting oxide substrates using aqueous and organic sols by means of dip coating followed by post annealing at 400 °C. The wetting of applied substrates by the prepared sol has been simply studied by observation and photography. The prepared thin films were also studied by various techniques including scanning electron microscopy, X-ray diffraction, and cyclic voltammetry in H_2SO_4 solution. The results showed that aqueous sols showed undesired wetting while aqueous-alcoholic sols could splendidly wet both glass and TCO substrates. However, the use of ethyl alcohol resulted in the degradation of the films during the drying process whereas this problem could be overcome by the introduction of heavy alcohols. Aqueous-alcoholic sols prepared from Lauryl Alcohol and peroxytungstic acid which was previously synthesized from sodium tungstate precursors were optimized as the dipping sol. Results showed that the presence of Lauryl alcohol reduces the size of the crystallites and grains in the prepared thin films. The monoclinic phase of WO_3 was transformed to triclinic phase by the addition of Lauryl alcohol to the prepared sol. The cyclic voltammetry analyses also verified the improved electrochromic properties of the prepared layers in the presence of Lauryl alcohol.

Keywords: Tungsten oxide, Sol-Gel, wetting, thin films.

*عهده‌دار مکاتبات

نشانی کرج، مشکن دشت، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادیها،

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۵۴۹۳، دورنگار: ۰۶۲۸۰۰۳۰، پیام‌نگار: mabahrevar@gmail.com

با وجود مزایای روش سل-ژل این روش مشکلاتی از قبیل زمان پرسه طولانی، قیمت نسبتاً بالاتر مواد اولیه، انقباض بسیار زیاد طی خشک کردن، در نتیجه ترک و غیریکنواختی در محصول نهایی و وجود گروههای آلی و هیدروکسیل در محصول نهایی از این دسته می‌باشند [۹]. در این کار سعی شده است تا کیفیت، یکنواختی و تکرارپذیری پوشش آماده شده با افزایش ترشوندگی زیرلایه با سل آماده شده بهبود یابد.

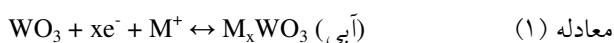
اکسید تنگستن هیدراته معمولاً محصول روش سل-ژل می‌باشد و عملیات حرارتی بعدی برای رسیدن به اکسید تنگستن لازم می‌باشد. مطالعاتی که توسط Senato و همکارانش [۸] توسط تکنیک طیفسنجی رaman بر روی محصول اولیه حاصل از سل-ژل و تاثیر عملیات حرارتی بر آن انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که اکسید تنگستن هیدراته کریستاله در محصول اولیه فرایند سل-ژل وجود دارد ولی این فازهای کریستاله را نمی‌توان به شبکه کریستالی هیدراته اکسید تنگستن ارتباط داد. پیک‌های رaman مربوط به اکسید تنگستن هیدراته حتی در بالای ۳۰۰ درجه وجود دارند در حالی که بعد از ۴۰۰ درجه کاملاً حذف شده و فاز اکسید تنگستن مونوکلینیک به راحتی قابل تشخیص است. پیش‌ماده‌های نسبتاً وسیعی برای تولید سل در دسترس است ولی اسیدتنگستیک و اسید پرواکسی تنگستیک دو محلول پرکاربرد برای تهیه سل می‌باشند.

معمولًا از اسیدی کردن سدیم تنگستات برای تهیه اسید تنگستیک [۱۱، ۱۰] استفاده می‌شوند. اسیدپروکسی تنگستیک [۱۵-۱۲] از حل کردن تنگستن فلزی در آب اکسیژنه تهیه می‌شود [۱۶]. این فرایند یک پرسه گرمaza بوده و ممکن است نیاز به کاهش دما باشد که $\text{K}_2\text{WO}_4 \cdot (\text{O}_2\text{H}_2\text{O}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$ بعد از حل کردن حاصل می‌شود [۱۷]. با زمان دادن به اسید تنگستیک ذرات بلورین $\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ تشکیل می‌شوند. از سوی دیگر ژلاسیون اسید پرواکسی تنگستیک با افزایش دما یا افزودن اسیدهای آلی در ۵۰ تا ۶۰ درجه شروع می‌شود که در نهایت منجر به تشکیل $\text{WO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ می‌شود [۱۸].

مورفولوژی WO_3 توسط روش سل-ژل می‌تواند با استفاده از کترل نحوه ورود پیش‌ماده‌ها و پرسه زمان‌دهی (ژلاسیون) به سمت دلخواه تغییر داده شود. Breedon و همکارانش [۱۶] به تازگی یک روش جدید برای تهیه

۱- مقدمه

الکتروکرومیزم تغییر برگشت‌پذیر رنگ مواد با اعمال پتانسیل می‌باشد. الکتروکرومیزم در اکسیدتنگستن با تغییر رنگ آن طی وارد و خارج شدن یون‌ها و یا الکترون‌ها اتفاق می‌افتد که طی معادله (۱) نشان داده شده است [۱، ۲].



که کاتیون M^+ می‌تواند H^+ , Na^+ , Li^+ , K^+ و ... باشد و مقدار X می‌تواند بین ۰ تا ۱ تغییر کند.

اکسید تنگستن یک نیمه‌هادی نوع n با گاف انرژی غیرمستقیم می‌باشد که به دلیل خواص فوق العاده آن برای کاربردهای الکتروکاتالیستی، فوتوكاتالیستی [۳]، سنسورهای گازی [۴] و الکتروکرومیزم [۵، ۶] بسیار مناسب است.

گاف انرژی آن بین $2.4-2.8\text{ eV}$ می‌باشد بنابراین برای کاربردهای فوتوكاتالیستی به دلیل همخوانی گاف انرژی آن با طیف انرژی نور مرئی در مقایسه با TiO_2 مناسب‌تر می‌باشد [۷]. تاکنون بیشترین مطالعه برای کاربردهای الکتروکرومیزم بر روی اکسید تنگستن صورت گرفته است و شرکت‌های بزرگی مانند شرکت اتمبیل سازی فورد از اکسیدتنگستن برای آماده سازی پنجره‌های هوشمند در اتمبیل‌های لوکس به شکل صنعتی استفاده کرده‌اند. روش‌های متفاوتی برای آماده سازی لایه‌های اکسید تنگستن گزارش شده است در این میان یکی از روش‌هایی که قابلیت تولید اکسید تنگستن نانوساختار با تخلخل کترل شده را دارد استفاده از روش سل-ژل می‌باشد [۸]. با ایجاد تخلخل با اندازه و توزیع کترل شده می‌توان لایه اکسید تنگستن را باسطح ویژه بسیار بالا بدون از دست دادن خواص اپتیکی آن آماده کرد. الکتروکرومیزم با سطح ویژه مواد ارتباط دارد و با افزایش سطح ویژه، مسیر نفوذ یون‌ها برای رنگی شدن کوتاه شده و ساختار کمتر تخریب می‌شود و زمان رنگی شدن و روشن شدن کوتاه شده و طول عمر افزایش می‌یابد. هدف کار حاضر در واقع پیدا کردن یک پرسه بهینه برای لایه نشانی اکسید تنگستن یکنواخت بر روی زیر لایه‌های الکترودهای شفاف (معمولًا لایه اکسید قلع آلاییده شده با فلورور یا لایه اکسید ایندیم آلاییده شده با قلع) می‌باشد. باید در نظر داشت که گرچه مقاومت‌های زیادی تهیه لایه اکسید تنگستن را به روش سل-ژل و فربوری گزارش کرده‌اند ولی

آمونیوم تنگستات قابل حل می باشد بنابراین به سوپرانسیون حاوی ذرات اسید هیدروکسی تنگستیک آمونیاک افروده می شود و دما نیز تا ۵۰ درجه سلسیوس افزایش می یابد که در نتیجه ذرات اسیدهیدروکسی تنگستیک کم کم به شکل آمونیوم تنگستات حل می شوند که در نهایت محلول کاملاً شفافی بدست می آید. محلول آبی حاصل می تواند برای لایه نشانی استفاده شود. با توجه به نتایج و دلایلی که در بخش های بعدی ارائه خواهد شد، سل های پایه آبی برای لایه نشانی روی شیشه و زیرلایه های دیگر مناسب نبودند و ترشوندگی نامطلوبی داشتند بنابراین برای افزایش ترشوندگی تلاش شد تا الكل به محلول آمونیوم تنگستات اضافه گردد ولی نتیجه دیگری که از انجام این کار بدست آمد در ادبیات علمی این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزودن اتانول به عنوان یک الكل برای افزایش ترشوندگی باعث رسوب سفید آمونیوم تنگستات می شود، به عبارت دیگر الكل ها و بخصوص اتانول به عنوان صدحلال آمونیوم تنگستات عمل می کنند. حتی افزودن

جدول ۱. مشخصات مواد اولیه به کار رفته در این تحقیق.

Name	Molar mass g/mol	Densityg/cm ³ (20 °C)	Form
Na ₂ WO ₄ •2H ₂ O	255	4,18	solid
W filament	183,84	19,25	solid
Ammonia	---	0,91	liquid
Poly Ethylene Glycol	----	2000	Solid
Oxalic acid	90,03	1,90	Solid
Lauryl alcohol	183,34	0,831	solid
Ethanol	46,06	0,78	Liquid

سورفتانت هایی مانند پلی اتیلن گلیکول نیز با زمان کمی طولانی تراژ مشابهی دارند، بنابراین بهبود ترشوندگی با الكل ها و سورفتانت ها در سل های آمونیوم تنگستاتی امکان پذیر نمی باشد. با لایه نشانی این سل به روش فربوری عملاً قطرات و جزیره هایی روی زیر لایه شیشه ای تشکیل شد که نشان از عدم ترشوندگی مناسب بود. تلاش گردید تا ضد حال (antisolvent) بودن الكل به عنوان یک روش برای لایه نشانی استفاده گردد بدین ترتیب که زیرلایه شیشه ای به محلول آمونیوم تنگستات آغشته و سپس به سرعت در اتانول فروبرده شد تا رسوب آمونیوم تنگستات بر روی زیرلایه شیشه ای

اسید تنگستیک از Na₂WO₄ و HNO₃ با استفاده از کنترل جریان این دو به جای هم زدن محلول این دو گسترش داده اند و ساختار صفحه ای مانند در سرعت جریان های بسیار پایین بدست آورده اند رطوبت نیز در طی ژلاسیون و زمان دهی نقش شکری بر مورفولوژی دارد و ساختار متخلخل تری در محیط های مرطوب قابل دسترس است.

۲- روش تحقیق

۲-۱- مشخصات مواد اولیه

بیشتر مواد اولیه استفاده شده محصول شرکت Merck می باشد. جدول (۱) مشخصات این مواد را نشان می دهد.

۲-۲- نحوه تهیه سل برای لایه نشانی
در ابتدا سدیم تنگستات در آب پختش گردیده و سپس با افزودن محلول ۱ مولار حاوی نسبت ۱ به ۱ اسید کلریدریک و نیتریک با استفاده از جایگزینی کاتیونی محتوی سدیم

جدول ۱. مشخصات مواد اولیه به کار رفته در این تحقیق.

پیش ماده حذف گردیده و هیدروژن جایگزین آن گردید. در این مرحله رنگ پودرهای سدیم تنگستات معلق در آب از سفید به زرد کمرنگ تغییر می یابد. رسوبات زرد رنگ حاصل پس از چندین بار با دکانته کردن محلول بالایی و اضافه کردن آب مقطر شستشو داده شد تا درنهایت pH محلول به محدوده خشتشی (بالای ۶) برسد. در مرحله بعد باید اسید هیدروکسی تنگستیک آماده شده به روش فوق، در یک محلول حل شود تا بتوان از آن در مراحل بعدی روش سل-ژل استفاده کرد. در این مرحله دو مسیر ممکن می باشد : اول این که اسید هیدروکسی تنگستیک در محیط قلیایی حاوی آمونیاک به شکل

انرژی (EDS) و برای بررسی‌های الکتروشیمیایی نیز دستگاه Ivium Stat استفاده شد. برای بررسی‌های الکتروشیمیایی و الکتروکروموزم لایه WO_3 آماده شده بر روی الکترود شفاف در محلول ۱ مولار H_2SO_4 قرار گرفت و ولتاویری چرخه‌ای در محدود ۰/۱ تا ۰/۶ ولت و با سرعت ۵۰ mV/S ثبت گردید. در اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی با سیستم ۳ الکترودی الکترود مرجع Ag/AgCl , الکترود کاری لایه و الکترود کمکی (مقابل) از جنس پلاتین بود.

۳- نتایج و بحث

۱-۱- بررسی لایه نازک اکسید تنگستن بر روی زیرلایه شیشه‌ای و ITO

مشاهدات چشمی لایه‌های نشانده شده با استفاده از سل آبی آمونیوم تنگستات و همچنین سل حاوی کمپلکس اسید اگزالیک با اسید تنگستیک و افزودنی لوریک الكل نشان می‌دهد که لایه حاصل از سل آبی آمونیوم تنگستات کاملاً غیریکنواخت است در حالی که لایه‌های حاصل از لایه‌نشانی با استفاده از سل حاوی کمپلکس اگزالیک کاملاً یکنواخت می‌باشد دلیل اصلی عمدتاً به ترشوندگی زیرلایه باز می‌گردد. الكل‌ها یک سر قطبی و یک سر غیرقطبی دارند و می‌توانند به عنوان یک سورفتکانت عمل کرده و حلالیت بالایی نیز در آب دارند. در مقایسه با سورفتکانت‌هایی همچون PEG که معمولاً در روش سل-ژل برای بهبود ترشوندگی استفاده می‌شود وزن کمتری داشته و راحت‌تر حل می‌شوند. سل حاصل نیز یکنواخت‌تر بوده و مهمتر این‌که سوختن آنها نیز راحت‌تر است و به دلیل داشتن اکسیژن در ساختارشان، حین سوختن کمتر کربونیزه می‌شوند در حالی که لایه حاوی PEG به آسانی نمی‌سوزد و رنگ سیاه ناشی از کربونیزه شده PEG در لایه حاوی از سل‌های PEG در دمای ۴۵۰ درجه قابل مشاهده است.

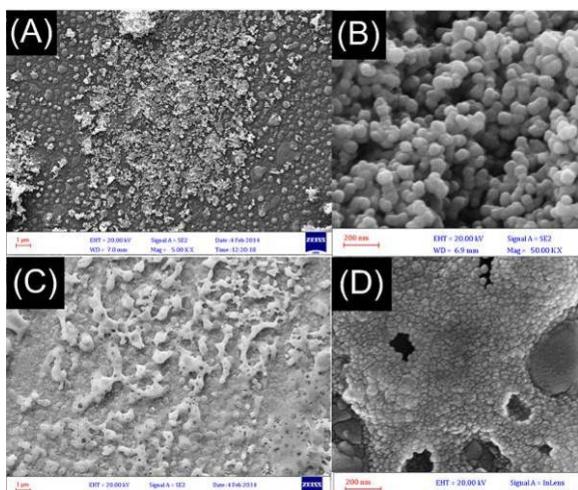
شکل (۱) تصویر قدرات سل‌های آماده شده برای لایه نشانی WO_3 بر روی زیرلایه الکترود شفاف را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود زاویه تماس پس از افزودن لوریک الكل به صفر کاهش پیدا کرده درحالی که در سل بدون لوریک الكل زاویه تماس بیشتر از ۶۰ درجه بوده که نشان از ترشوندگی نامطلوب می‌باشد.

تشکیل شود که با عملیات حرارتی به اکسید تنگستن تبدیل شد ولی نتایج منجر به تشکیل یک لایه غیریکنواخت و با ناهمواری بسیار بالا بود. البته این روش می‌تواند برای گسترش روش‌هایی همچون میکروامولسیون برای تولید نانوذرات اکسید تنگستن با مورفولوژی کاملاً کروی و محدوده باریک توزیع اندازه ذرات استفاده گردد ولی با توجه به نتایج برای لایه نشانی روش مناسبی نیست.

مسیر دیگر برای حل کردن اسید هیدروکسی تنگستیک استفاده از اسیدهای آلی مانند اسیداگزالیک است. اضافه کردن اسیداگزالیک به سوسپانسیون حاوی اسید هیدروکسی تنگستیک باعث حل شدن آن به شکل کمپلکس می‌شود که محلول حاصل می‌تواند برای لایه‌نشانی استفاده شود. خوبی محلول آماده شده در این مرحله این است که اضافه کردن الكل‌ها (مانند اتانول) و سورفتکانت‌ها (مانند PEG) باعث رسوب در آن نمی‌شود و می‌توان ترشوندگی را با آنها بهبود داد. نتایج مشاهدات نشان می‌دهد که اضافه کردن الكل‌ها مانند اتانول بهتر از PEG ترشوندگی را بهبود می‌دهد ولی مشکل در زمان خشک شدن به وجود می‌آید. در حین خشک شدن، الكل‌های سبک مانند اتانول زودتر از آب تبخیر شده که باعث کاهش ترشوندگی حین خشک شدن و کم قدرات مجزایی تشکیل و درنهایت لایه مناسبی تشکیل نمی‌شود. برای حل این مشکل با توجه به تبخیر زودتر الكل‌های سبک، الكل‌سنگین‌تری مانند لوریک الكل را انتخاب کردیم که دیرتر از آب تبخیر شده و لذا ترشوندگی حین لایه نشانی حفظ شود. درنهایت این مسیر به عنوان روش بهینه برای لایه نشانی تعیین گردید.

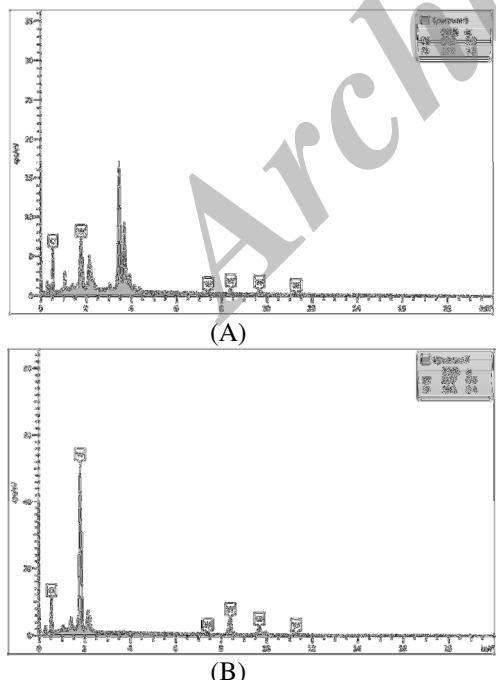
۲-۳- روش‌های شناسایی و بررسی نمونه‌ها

لایه‌های آماده شده با استفاده از تکنیک‌های پراش اشعه X، مشاهدات چشمی، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM و همچنین سنجش‌های الکتروشیمیایی بررسی گردیدند. پراش اشعه X با استفاده از پراش‌سنج Philips DW3710 با تابش $\text{Cu K}\alpha$ و ولتاژ و آمپراژ به ترتیب ۵۰ kV و ۲۵۰ mA و در محدوده ۲۰-۵۰ درجه ثبت گردید. همچنین از دستگاه ZEISS برای ثبت تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بیم الکترونی ۳۰ kV و طیف نگار تفکیک

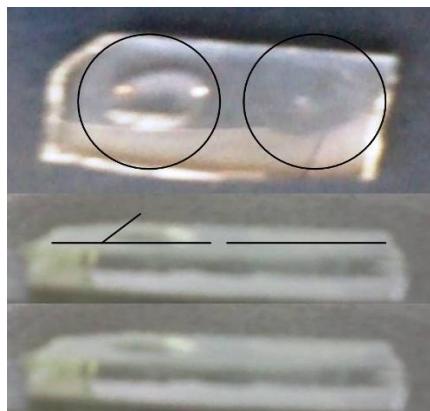


شکل ۲. تصاویر نمونه‌های لایه نازک آماده شده با استفاده از سل حاوی کمپلکس اگزالیک (A, B) و با حضور آن (C, D).

نتایج EDS نمونه‌ها نیز در شکل (۳) مشاهده می‌شود در الگوی EDS نمونه تهیه شده از سل حاوی لوریک الكل میزان اکسیژن بیشتر و پیک‌های دیگری نیز مشاهده می‌شود که مربوط به قلع در زیر لایه الکترود شفاف می‌باشند. چون در این نمونه لایه یکنواخت بوده و ضخامت کمی دارد عناصر زیر لایه نیز مشاهده شده اند در حالی که در مورد نمونه اول چون قسمتی از لایه (که ضخامت زیادی دارد) آنالیز شده است و ترکیب شیمیابی زیر لایه مشاهده نشده است.



شکل ۳. الگوی طیف نگار تفکیک انرژی (EDS) نمونه‌های لایه نازک آماده شده با استفاده از سل حاوی کمپلکس اسیداگزالیک با حضور (A) و بدون حضور لوریک الكل (B).



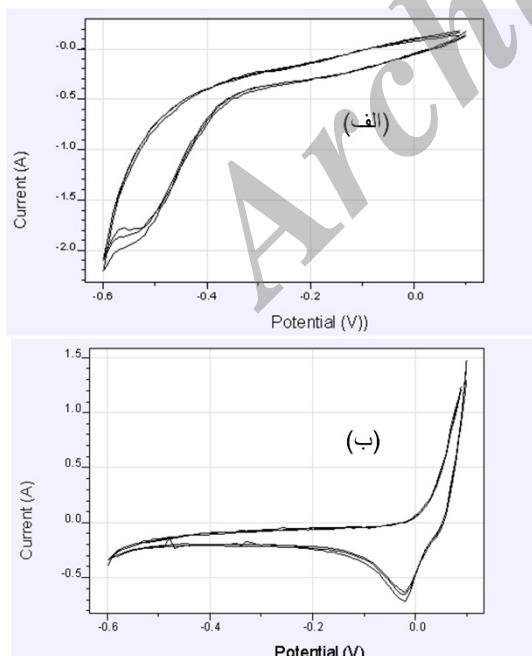
شکل ۱. ترشوندگی سل حاوی کمپلکس اگزالیک اسید با تینگستن در حضور لوریک الكل (سمت راست) و عدم حضور آن (سمت چپ).

شکل (۲) تصاویر SEM نمونه‌های لایه نازک آماده شده با استفاده از روش بهینه یعنی سل حاوی کمپلکس اسید اگزالیک با و بدون حضور لوریک الكل را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود لایه در حضور لوریک الكل یکنواخت‌تر می‌باشد درحالی که بدون حضور لوریک الكل عملاً جزیره‌هایی مجزا تشکیل شده و سطح بسیار ناصاف است. مشاهدات اولیه نیز حاکی از چسبندگی نامطلوب لایه WO_3 بدون حضور لوریک الكل می‌باشد. نکته دیگر اندازه دانه‌ها است که از حدود $40\text{--}50\text{ nm}$ در نمونه آماده شده از سل بدون لوریک الكل به زیر 20 nm پس از استفاده از لوریک الكل کاهش می‌یابد. تخلخل‌ها و حفراتی نیز در لایه پس از افزودن لوریک الكل مشاهده می‌شود. سوختن لوریک الكل و گازهای حاصل از آن، از رشد دانه جلوگیری کرده و حفراتی نیز در لایه ایجاد می‌کند. در محلهایی از تصاویر، دانه‌های درشت‌تر مشاهده می‌شوند که احتمالاً به دلیل گرمای موضعی حین سوختن در بعضی مناطق و تراکم بالاتر رشد بیشتری در این مناطق افتاده است. کاهش اندازه دانه‌ها و افزایش سطح ویژه لایه به شرطی که چسبندگی لایه کاهش نیابد برای کاربردهای الکتروکرومیزم مطلوب می‌باشد زیرا همان‌طور که در مقدمه گزارش گفته شد الکتروکرومیزم پدیده‌های سطحی بوده و با افزایش سطح ویژه و کوتاه شدن مسیر نفوذ یون هیدروژن زمان پاسخ دهی رنگی بهبود می‌یابد. نتایج ولتاوری چرخه‌ای که در سرعت‌های مختلف ثبت گردیده مovid این مطلب می‌باشد (با افزایش سرعت روش ولتاوری لایه آماده شده از سل حاوی سوختن لوریک الكل محل پیک کمتر

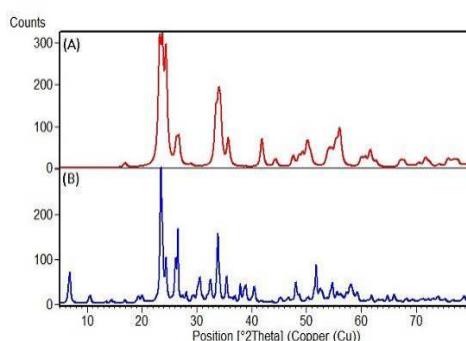


شکل ۵. تصویر لایه WO_3 پس از رنگی شدن با اعمال ولتاژ در محلول اسید سولفوریک.

شکل (۶) ولتامتری چرخه‌ای لایه‌های آماده شده را در محلول اسید سولفوریک نشان می‌دهد. حین اعمال ولتاژ منفی بر الکترود شفاف (الکترود کاری) لایه WO_3 آماده شده از سل حاوی لوریک الكل به سرعت تیره گردید که به دلیل نفوذ یون هیدروژن در ساختار WO_3 می‌باشد درحالی که در نمونه دیگر رنگی شدن اتفاق نمی‌افتد که احتمالاً به دلیل عدم چسبندگی و تماس لایه WO_3 با زیرلایه می‌باشد. ولتاوموگرام‌ها نیز چنین ایده‌ای را تایید می‌کنند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در نمونه آماده شده از سل حاوی لوریک الكل با منفی شدن ولتاژ، جریان با شبیه نسبتاً زیادی افزایش یافته و پیکی در محدوده ۰،۰-۰،۵ ولت دیده می‌شود درحالی که در نمونه دیگر چنین پیکی مشاهده نمی‌شود و پیکی که در ولتاوموگرام این نمونه در ولتاژهای منفی‌تر (۰،۵-۰،۷ ولت) دیده شد، می‌تواند به آزاد شدن گاز هیدروژن نسبت داده شود.



شکل ۶. ولتامتری چرخه‌ای لایه آماده شده از سل حاوی کمپلکس اسید اگزالیک با تنگستن در (الف) عدم حضور (ب) حضور لوریک الكل در محلول اسید سولفوریک.



شکل ۴. الگوی پراش اشعه ایکس نمونه‌های لایه نازک آماده شده با استفاده از سل حاوی کمپلکس اسید اگزالیک با حضور لوریک الكل (A) و بدون آن (B).

شکل (۴) نیز الگوی پراش اشعه ایکس نمونه‌ها را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که تنگستن با ساختار تری-کلینیک (گروه فضایی $1-1\bar{2}/m$) طی پروسه به کار گرفته شده در حضور لوریک الكل حاصل می‌گردد در حالی که در عدم حضور لوریک الكل تنگستن با فاز مونوکلینیک (گروه فضایی $1-1\bar{2}/m$) تشکیل می‌شود پیک‌های مربوط به زیرلایه FTO نیز قابل مشاهده است. سایز بلورک‌ها نیز با استفاده از رابطه شر براي نمونه‌ها محاسبه گردید که به ترتیب برابر با ۴۰ و ۱۵ نانومتر برای نمونه‌های آماده شده از سل کمپلکس اسید اگزالیک بدون و با حضور لوریک الكل می‌باشد. نتایج مovid این مطلب است که پایداری فازهای مختلف اکسید تنگستن به اندازه دانه‌ها در آن وایسته است و با کاهش اندازه آنها فازهای دما بالاتر در دمای اتفاق پایدار می‌شوند و چنین مشاهده‌ای در سیستمها و ترکیبات دیگر نیز گزارش شده است به عنوان مثال فاز آناتاز که فاز دما بالای تیتانیا می‌باشد با کاهش اندازه ذرات و بلورک‌های تیتانیا جایگزین فاز روتایل می‌شود. در ترکیب ایتریا نیز فاز مونوکلینیک دما بالا جایگزین فاز مکعبی با کاهش اندازه بلورک‌ها تا ۷ نانومتر می‌شود.

شکل (۵) تصویر لایه WO_3 بهینه را پس از رنگی شدن در محلول اسید سولفوریک با اعمال میدان نشان می‌دهد. تیره شدن قسمتی از لایه که در محلول قرار گرفته است به خوبی مشهود است.

6. Bathe, S. R., Patil, P. S., Electrochromic Characteristics of Pulsed Spray Pyrolyzed Polycrystalline WO_3 Thin Films,*Smart Mater. Struct.*, 2009, 18
7. Santato, C., Ulmann, M., Augustynski, J., Photoelectrochemical Properties of Nanostructured Tungsten Trioxide Films,*J Phys Chem B*, 2001, 105, 936.
8. Santato, C., Odziemkowski, M., Ulmann, M., Augustynski, J., Crystallographically Oriented Mesoporous WO_3 Films: Synthesis, Characterization, and Applications,*J. Am. Chem. Soc.*, 2001, 123, 10639.
9. Mackenzie, J. D., Applications of the Sol-Gel Process,*J. Non Cryst. Solids*, 1988, 100, 162.
10. Bica, E., Mureşan, L. E., Barbu-Tudoran, L., Indrea, E., Popescu, I. C., opovici, E., Studies on WO_3 Thin Films Prepared by Dip-Coating Method,*Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia*, 2009, 3, 15.
11. Wang, W., Pang, Y., Hodgson, S. N. B., On Key Factors for the Fabrication of Mesoporous Tungsten Oxide Films from Tungstic Acid,*J. Sol Gel Sci. Technol.*, 2011, 58, 135.
12. Deepa, M., Saxena, T. K., Singh, D. P., Sood, K. N., Agnihotry, S. A., Spin Coated Versus Dip Coated Electrochromic Tungsten Oxide Films: Structure, Morphology, Optical and Electrochemical Properties,*Electrochim. Acta*, 2006, 51, 1974.
13. Deepa, M., Singh, P., Sharma, S. N., Agnihotry, S. A., Effect of Humidity on Structure and Electrochromic Properties of Sol-Gel-Derived Tungsten Oxide Films,*Solar Energy Mater. Solar Cells*, 2006, 90, 2665.
14. Fang, Y., Sun, X., Cao, H., Influence of PEG Additive and Annealing Temperature on Structural and Electrochromic Properties of Sol-Gel Derived WO_3 Films,*J. Sol Gel Sci. Technol.*, 2011, 59, 145.
15. Srivastava, A. K., Agnihotry, S. A., Deepa, M., Sol-Gel Derived Tungsten Oxide Films with Pseudocubic Triclinic Nanorods and Nanoparticles,*Thin Solid Films*, 2006, 515, 1419.
16. Breedon, M., Spizzirri, P., Taylor, M., Plessis, J. D., McCulloch, D., Zhu, J., Yu, L., Hu, Z., Rix, C., Włodarski, W., Kalantar-zadeh, K., Synthesis of Nanostructured Tungsten Oxide Thin Films: A Simple, Controllable, Inexpensive, Aqueous Sol-Gel Method,*Cryst. Growth Des.*, 2010, 10, 430.
17. Livage, J., Ganguli, D., Sol-Gel Electrochromic Coatings and Devices: A Review,*Solar Energy Mater. Solar Cells*, 2001, 68, 365.
18. Yang, B., Zhang, Y., Drabarek, E., Barnes, P. R. F., Luca, V., Enhanced photoelectrochemical Activity of Sol-Gel Tungsten Trioxide Films through Textural Control,*Chem. Mater.*, 2007, 19, 5664.

۴- نتیجه گیری

نتایج این کار نشان می‌دهد که سل‌های آبی برای لایه نشانی اکسید تنگستن بر روی شیشه و الکترود شفاف اکسیدی در روش شیمیایی مناسب نمی‌باشند در حالی که سل آبی-آلی آماده شده در محلول اسید اگزالیک و حاوی لوریک الكل زیر لایه شیشه‌ای و الکترود شفاف مورد استفاده را به خوبی تر می‌کند و می‌تواند برای لایه نشانی اکسید تنگستن استفاده شود. به عنوان نتیجه جانبی مشاهده گردید الكل‌ها و سورفتانت‌ها ضدحلال (antisolvent) آمونیوم تنگستات در آب می‌باشند که این نتیجه می‌تواند به عنوان پایه برای ابداع روش‌های جدید سنتز اکسید تنگستن مورد استفاده قرار گیرد. نتایج آنالیزها نشان می‌دهد اندازه دانه‌ها و بلورک‌ها لایه‌های نازک آماده شده به روش فروبری از سل کمپلکس اسید اگزالیک با تنگستن با افزودن لوریک الكل کاهش می‌یابد و فاز اکسید تنگستن نیز از مونوکلینیک به تری کلینیک تغییر می‌کند. داده‌های ولتاوی چرخشی نیز خواص بهتر الکتروکرومیک لایه آماده شده در حضور لوریک الكل را تایید می‌کند.

مراجع

1. Granqvist, C.G, Handbook of inorganic materials; Elsevier Science, Oxford, 1995.
2. Deb, S. K., Opportunities and Challenges in Science and Technology of WO_3 for Electrochromic and Related Applications,*Solar Energy Mater. Solar Cells*, 2008, 92, 245.
3. Guo, Y., Quan, X., Lu, N., Zhao, H., Chen, S., High Photocatalytic Capability of Self-Assembled Nanoporous WO_3 with Preferential Orientation of (002) Planes,*Environ. Sci. Technol.*, 2007, 41, 4422.
4. Nimittrakoolchai, O., Supothina, S., High-Yield Precipitation Synthesis of Tungsten Oxide Platelet Particle and its Ethylene Gas-Sensing Characteristic,*Mater. Chem. Phys.*, 2008, 112, 270.
5. Wang, W., Pang, Y. Hodgson, S. N. B., preparation, Preparation,Characterization and Electrochromic Property of Mesostructured Tungsten Oxide Films Via a Surfactant Templatized Sol-Gel Process from Tungstic Acid,*J. Sol Gel Sci. Technol.*, 2010, 54,